

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Inventors: Werner SCHOMBURG et al.
Title: SENSOR FOR THE MEASUREMENT OF
FLOWSPEEDS AND METHOD FOR
OPERATING THE SAME
Appl. No.: Not Yet Assigned
Atty Dkt No: 31775-198246 RK

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 101 24 964.0

Anmeldetag: 21. Mai 2001

Anmelder/Inhaber: Forschungszentrum Karlsruhe GmbH,
Karlsruhe, Baden/DE

Bezeichnung: Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindig-
keiten und Verfahren zu dessen Betrieb

IPC: G 01 F 1/692

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 23. April 2002
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Wehner

Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH
ANR 5661498

Karlsruhe, den 21. Mai 2001
PLA 0122 Gü/he

**Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten
und Verfahren zu dessen Betrieb**

Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH
ANR 5661498

Karlsruhe, den 21. Mai 2001
PLA 0122 Gü/he

Patentansprüche

1. Sensor zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Gasen oder Flüssigkeiten, bestehend aus
 - a) einer Trägermembran im wesentlichen in Form einer Fahne und die nur zu einem kleinen Teil ihres Umfangs als Halteelement ausgebildet ist, wobei die Halteelemente so angeordnet sind, dass nur ein Randbereich der Trägermembran mechanischen Spannungen ausgesetzt wird, und
 - b) einer elektrischen Leiterbahn (6) mit Zuleitungen auf der Trägermembran, wobei die elektrische Leiterbahn (6) durch einen elektrischen Strom gegenüber der Umgebung erwärmt werden kann.
2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran aus einem Polymer besteht.
3. Sensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Leiterbahn (6) aus einem Metall besteht.
4. Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägermembran aus zwei Lagen (4, 5) aufgebaut ist, welche die elektrische Leiterbahn (6) umschließen.
5. Sensor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Lagen (4, 5) der Trägermembran gleich dick sind.
6. Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägermembran in einem Gehäuse mit fluidischen Zu- und Ableitungen (8, 9) derart gehaltert ist, dass das Medium im wesentlichen parallel zur Ebene der Trägermembran fließt.

7. Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägermembran an vier Punkten fixiert ist und leicht durchhängt.
8. Verfahren zum Betrieb eines Sensors gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 mit folgenden Verfahrensschritten
 - a) Beaufschlagen der elektrischen Leiterbahn 6 mit einem anwachsenden elektrischen Strom I solange, bis der Spannungsabfall über der Leiterbahn 6 sich um einen vorgegebenen Wert Δu erhöht hat,
 - b) Ermitteln der Strömungsgeschwindigkeit aus dem Δu mit Hilfe einer Kalibrierkurve und
 - c) Abkühlen der Leiterbahn (6) durch Reduktion des Stromes und gegebenenfalls Durchführen weiterer Messungen gemäß den Schritten a) und b).

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft einen Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten und ein Verfahren zu dessen Betrieb.

In dem Artikel "Micro Fluid Sensors and Actuators" von G. Stemme, der 1995 in den Proceedings zum 6. internationalen Symposium on Micro Machine and Human Science auf den Seiten 45 - 52 erschienen ist, sind verschiedene Möglichkeiten dargestellt, wie Sensoren für die Messung von Strömungsgeschwindigkeiten aufgebaut werden können. Unter anderem ist beschrieben, wie eine auf einer dünnen Membran angebrachte Leiterbahn durch einen elektrischen Strom auf einer konstanten Temperatur gehalten wird und die Energie zum Aufrechterhalten der Temperatur zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit dient. Nähere Beschreibungen dazu, wie ein solcher Sensor betrieben werden kann finden sich auf den Seiten 159 - 163 in dem Buch „Strömungs- und Durchflußmeßtechnik“ von Otto Fiedler, das 1992 im Oldenbourg-Verlag erschienen ist.

In dem Artikel „AMANDA-surface micromachining, molding, and diaphragm transfer“, der von W.K. Schomburg et. al. in der Zeitschrift Sensors and Actuators A, Band 76, auf den Seiten 343 bis 348 publiziert wurde, ist ein Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten beschrieben, bei dem der Druckabfall über einer Kapillare mit einem Drucksensor gemessen wird. Der Druckabfall ist proportional zur Strömungsgeschwindigkeit und kann deshalb zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit herangezogen werden. Der in diesem Sensor verwendete Drucksensor enthält Dehnungsmessstreifen, die auf einer dünnen Membran angebracht sind.

Nachteilig bei beiden hier beschriebenen Methoden zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten ist, dass von außen auf das Gehäuse des Sensors einwirkende Kräfte sowie thermische Dehnungen des Gehäuses aufgrund von Änderungen der Umgebungstemperatur die Leiterbahn dehnen können, sodass sich deren elektrischer

Widerstand verändert, wodurch eine veränderte Strömungsgeschwindigkeit vorgetäuscht wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten zur Verfügung zu stellen, bei dem von außen einwirkende Kräfte und Temperaturänderungen nur noch in sehr geringem Maße Einfluss auf das Sensorsignal haben, und ein Verfahren zu dessen Betrieb anzugeben. Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Patentansprüche 1 und 8. Die übrigen Ansprüche beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von den Figuren 1 bis 5 und zwei Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigen die Figuren 1, 2 4 und 5 schematisch den Aufbau von 2 Sensoren. Die Figuren sind nicht maßstäblich gezeichnet, um sehr dünne bzw. kleine Strukturen neben vergleichsweise großen Strukturen deutlich werden zu lassen. Die Figur 3 zeigt Strom- und Spannungsverlauf bei einer Messung.

Die **Anwendungsbeispiele** beschreiben vorteilhafte Ausführungen der Sensoren.

Das **erste Anwendungsbeispiel** beschreibt eine zungenförmige Membranstruktur, die in einem Hohlraum frei aufgehängt ist. In dem von einer Gehäuseoberhälfte 1 und einer Gehäuseunterhälfte 2 gebildeten Hohlraum 7 wurde, wie in Figur 1 dargestellt ist, eine Membranstruktur 3 angebracht. Diese Membranstruktur 3 besteht aus zwei Lagen 4 bzw. 5, zwischen denen eine Leiterbahn 6 angebracht wurde, wie es in Figur 2 in Aufsicht schematisch gezeigt ist. Die hier gezeigte mäanderförmige Leiterbahn kann auch anders ausgeführt werden z.B. als bifilare Spirale. Dies hat den Vorteil, dass dies die Antenneneigenschaften der Leiterbahn 6 reduziert. Die Gehäuse wurden aus Polysulfon gefertigt und besitzen den fluidischen Zulauf 8 und Ablauf 9. Zulauf und Ablauf können auch anders als hier dargestellt z.B. diametral angeordnet sein. Die Membranlagen 4 und 5 wurden aus Polyimid und die Leiterbahn 6 aus Platin hergestellt. Die Dicke der Membranlagen

4 und 5 beträgt jeweils nur ca. 1 μm und die Dicke der Leiterbahn 6 nur ca. 100 nm. Dadurch ist die Wärmekapazität der Membranstruktur 3 sehr gering und ihre Temperatur passt sich sehr schnell der Temperatur des Mediums an, das den Hohlraum 7 erfüllt. Es wurden ca. 7 μm breite Leiterbahnen 6 mit Längen zwischen 1,9 und 34,7 mm hergestellt, deren elektrischer Widerstand zwischen 100 Ω und 10 k Ω lag. Die Außenabmessungen des Gehäuses betrugen in diesem Fall 5,5 · 4,5 · 1,2 mm³.

Ein an der Leiterbahn 6 vorbeiströmendes Medium kühlt die Leiterbahn 6 ab, wobei die Kühlleistung von der Strömungsgeschwindigkeit abhängig ist. Der elektrische Widerstand der Leiterbahn 6 ist proportional zu ihrer Temperatur, deshalb ändert sich der Widerstand in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit.

Wegen der geringen Dicke der Membranstruktur 3 und ihrer damit verbundenen geringen Wärmekapazität kann sie sehr schnell durch einen elektrischen Strom durch die Leiterbahn 6 erwärmt und nach dessen Abschalten wieder auf die Temperatur des den Hohlraum 7 erfüllenden Mediums abgekühlt werden. Dies ermöglicht, wie weiter unten beschrieben wird, eine temperaturunabhängige Strömungsmessung mit nur einer Leiterbahn 6, hat aber den Nachteil, dass von außen auf das Gehäuse einwirkende mechanische Spannungen und Kräfte, wie sie z. B. durch Temperaturänderungen des Gehäuses 1 bzw. 2 auftreten können, zu Dehnungen der Membranstruktur 3 führen, die den Widerstand der Leiterbahn 6 ändern und so die Messung der Strömungsgeschwindigkeit beeinträchtigen.

Deshalb ist die Membranstruktur 3 über Stege 3a mit dem Gehäuse 1 bzw. 2 verbunden. Dadurch können von außen auf das Gehäuse einwirkende mechanische Spannungen und Kräfte, nur zu sehr geringen Dehnungen des Teiles 3b der Membranstruktur 3 führen, der den sensitiven Teil der Leiterbahn 6 enthält. Dadurch wird

vermieden, dass Dehnungen der Leiterbahnen zu einer Änderung ihres elektrischen Widerstandes und damit zu einer störenden Beeinflussung des Sensorsignals führen.

Es ist auch möglich, statt der Stege 3a einen festen Bestandteil mindestens einer der Gehäusenhälften 1 oder 2 vorzusehen, an dem der Teil 3b der Membranstruktur angebracht ist.

Die Polyimidschichten 4 und 5 werden soweit technisch möglich in der gleichen Dicke hergestellt, damit die Leiterbahn 6 in der Mitte der Membranstruktur 3 auf der sogenannten neutralen Faser zu liegen kommt, die durch Biegungen der Membranstruktur 3 nicht gedehnt wird. Solche Biegungen der Membranstruktur 3 können z.B. auftreten, wenn das den Hohlraum 7 durchströmende Medium zu einer Art Flatterbewegung der Membranstruktur 3 führt, wie sie von Flaggen bekannt ist.

Durch die Leiterbahn 6 wird, wie es in Figur 3a gezeigt ist, mit einer Steuerspannung U einstellbare Stromquelle ein vorgegebener elektrischer Strom I_0 geschickt, der so klein ist, dass er zu keiner wesentlichen Erwärmung der Leiterbahn 6 führt. Der elektrische Widerstand der Leiterbahn 6 ist von ihrer Temperatur - also der Temperatur des den Hohlraum 7 erfüllenden Mediums - abhängig. Deshalb stellt sich über der Leiterbahn 6 eine von der Medientemperatur abhängige Spannung u_0 ein (vgl. Figur 3b), die nach Ablauf der Zeit Δt_1 gespeichert wird.

Nach dem Speichern von u_0 wird eine neue Steuerspannung U_1 bestimmt, mit deren Hilfe ein Strom I_1 durch die Leiterbahn 6 erzeugt wird. Die anfängliche Größe U_1 der Steuerspannung ist der gemessenen Spannung u_0 proportional. Der Proportionalitätsfaktor wird bei der Kalibrierung des Sensors geeignet festgelegt. Die Steuerspannung U und damit der Strom I durch die Leiterbahn 6 wird solange erhöht, bis die anfängliche Spannung u_1 , die sich über der Leiterbahn 6 nach dem Einschalten des Stromes I_1 einstellt, um einen vorgegebenen Betrag Δu erhöht ist.

Das Mess-Ergebnis ergibt sich, wie es in Figur 3c dargestellt ist, aus der Differenz ΔU der Regelspannungen U_2 und U_1 , die den elektrischen Strömen I_2 und I_1 proportional sind.

Das dem Messverfahren zugrunde liegende Prinzip besteht darin, dass der Aufheizvorgang der Leiterbahn 6 analysiert wird. Das Messergebnis wird ermittelt aus der elektrischen Energie, die benötigt wird, um die Temperatur und damit den davon abhängigen Widerstand der Leiterbahn 6 um einen vorgegebenen Betrag zu erhöhen.

In der realisierten Schaltung wird dies dadurch erreicht, dass in einem Zeitintervall Δt_1 der von der Temperatur des den Hohlraum 7 erfüllenden Mediums abhängige Widerstand der Leiterbahn 6 mit einem kleinen Strom I_0 gemessen wird und in dem anschließenden Zeitintervall Δt_2 ermittelt wird, um wieviel der Strom I erhöht werden muss, um den Widerstand um einen vorgegebenen Betrag zu erhöhen.

Wegen der geringen Wärmekapazität des sensitiven Teils 3b der Membranstruktur 3 brauchte das Zeitintervall Δt_2 nur 7 ms und das Zeitintervall Δt_1 nur 20 bis 40 ms lang zu sein, um zuverlässige Messungen mit Luft als Medium ausführen zu können. Mit Hohlräumen 7 mit einem Querschnitt von $390 \cdot 240 \mu\text{m}^2$ wurden Flussmessungen zwischen $100 \mu\text{l/min}$ und 500 ml/min durchgeführt. Durch eine Anpassung des Querschnittes ist es möglich den Messbereich zu verändern. Dabei ergibt sich für sehr kleine Flussraten die Einschränkung, dass ein sehr kleiner Querschnitt des Hohlraumes 7 die Gefahr dafür erhöht, dass im Medium enthaltene Partikel oder Gasblasen den Hohlraum 7 ganz oder teilweise verschließen und damit die Messergebnisse beeinträchtigen. Typischerweise sind Querschnitte von $100 \cdot 100 \mu\text{m}^2$ noch geeignet. Es sind aber auch Querschnitte von $10 \cdot 10 \mu\text{m}^2$ möglich, wenn mit sehr reinen Medien gearbeitet wird, wie dies z. B. bei der Dosierung von Medikamenten der Fall sein kann. Die Flussrate von Wasser wurde mit dem hier beschriebenen Sensor zwischen $4 \mu\text{l/min}$ und $200 \mu\text{l/min}$ gemessen. Diese Messung wurde aufgrund einer Ka-

librierung des Sensors mittels Wägung möglich. Die Kalibrierung für den Gasbetrieb wurde mit einem geeigneten Standardprüfmittel (Flusssensor der Firma MKS) durchgeführt. Bei gasförmigen Medien sind gegenüber flüssigen Medien um etwa einen Faktor 10 verminderte elektrische Leistungen für die Ansteuerung der Leiterbahn 6 erforderlich.

Der zungenförmig ausgebildete Teil 3b der Membranstruktur 3 behält auch dann seine Form bei, wenn die Strömungsrichtung nicht wie in Figur 2 durch Pfeile angedeutet, von der Aufhängung 3a der Membranstruktur 3 weggerichtet ist. Allerdings kann ein zungenförmig ausgebildeter Teil 3b der Membranstruktur 3 durch eine auf die Aufhängung zu gerichtete Strömung umgefaltet oder geknickt werden, wenn die Strömungsgeschwindigkeit einen kritischen Wert überschreitet. Ein umgefalteter oder umgeknickter Teil 3b der Membranstruktur 3 kann zu falschen Messwerten für die Strömungsgeschwindigkeit führen und sollte deshalb vermieden werden. Dies kann durch eine Begrenzung der möglichen Strömungsgeschwindigkeit oder eine Festlegung der Strömungsrichtung z. B. durch ein passives Ventil erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Aufhängung der Membranstruktur 3 anders zu gestalten, wie es im zweiten Anwendungsbeispiel dargestellt ist.

Es ist auch möglich, zwei Sensorelemente in getrennten Hohlräumen 7 nebeneinander anzubringen und durch vorgeschaltete passive Ventile sicherzustellen, dass der eine Hohlraum immer nur in eine Richtung durchströmt wird, während der andere Hohlraum immer in der entgegengesetzten Richtung durchströmt wird. Zungenförmige Teile 3b der Membranstruktur 3 können dann jeweils der Strömungsrichtung entsprechend ausgerichtet sein. Darüber hinaus ist es mit einer solchen Anordnung möglich, die Strömungsrichtung zu erfassen, indem festgestellt wird, welcher Sensor angesprochen hat.

In einem **zweiten Anwendungsbeispiel** wird ein Sensor beschrieben, bei dem die Membranstruktur 3 an vier Stegen 3a aufgehängt ist.

In Figur 4 ist eine Membranstruktur 3 mit Leiterbahnen 6 aus Gold gezeigt, die über vier Stege 3a mit dem Gehäuse 1 bzw. 2 verbunden ist. Vorteilhaft bei dieser Ausgestaltung ist, dass der Teil 3b der Membranstruktur 3 nicht umklappen oder umknicken kann, wenn sich die Strömungsrichtung umkehrt. Andererseits ist es bei dieser Ausgestaltung wichtig, dass die Stege 3a der Membranstruktur 3 flexibel genug sind, um mechanische Spannungen, die vom Gehäuse ausgehen, nicht oder nur wenig auf den Teil 3b der Membranstruktur zu übertragen.

Eine andere Möglichkeit, die Übertragung von mechanischen Spannungen vom Gehäuse auf die Membranstruktur 3 zu übertragen, besteht darin, die Membranstruktur 3 im wesentlichen schlaff auszubilden, sodass sie, wie es in Figur 5 gezeigt ist, im Hohlraum 7 etwas durchhängt. Wenn sich eine Dehnung des Gehäuses auf eine solche Membranstruktur 3 überträgt, ändert sich nur das Ausmaß, um das die Membranstruktur 3 durchhängt, ohne dass sich eine wesentliche Änderung der mechanischen Spannung der Membran einstellt.

Zusammenfassung:

Die Erfindung betrifft einen Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten und ein Verfahren zu dessen Betrieb.

Aufgabe der Erfindung ist es, den Sensor so auszugestalten, dass von außen einwirkende Kräfte und Temperaturänderungen nur noch in sehr geringem Maße Einfluss auf das Sensorsignal haben.

Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Trägermembran im wesentlichen in Form einer Fahne und die nur zu einem kleinen Teil ihres Umfangs als Halteelement ausgebildet ist, wobei die Halteelemente so angeordnet sind, dass nur ein Randbereich der Trägermembran mechanischen Spannungen ausgesetzt wird, und eine elektrische Leiterbahn mit Zuleitungen auf der Trägermembran.

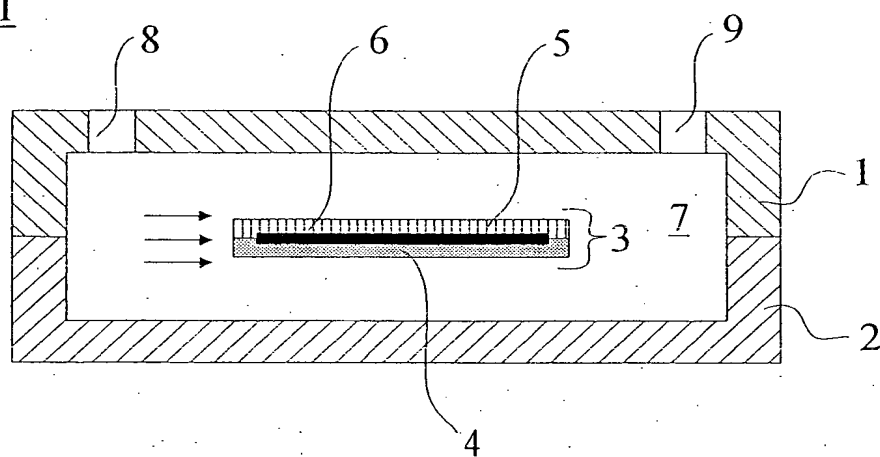
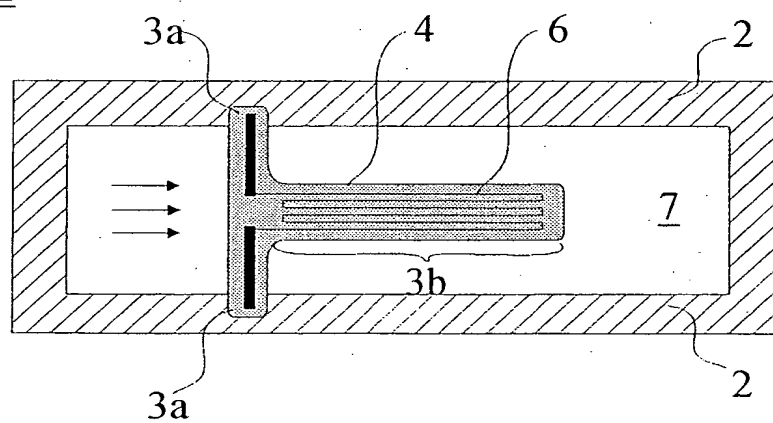
Fig. 1Fig. 2

Fig. 3a

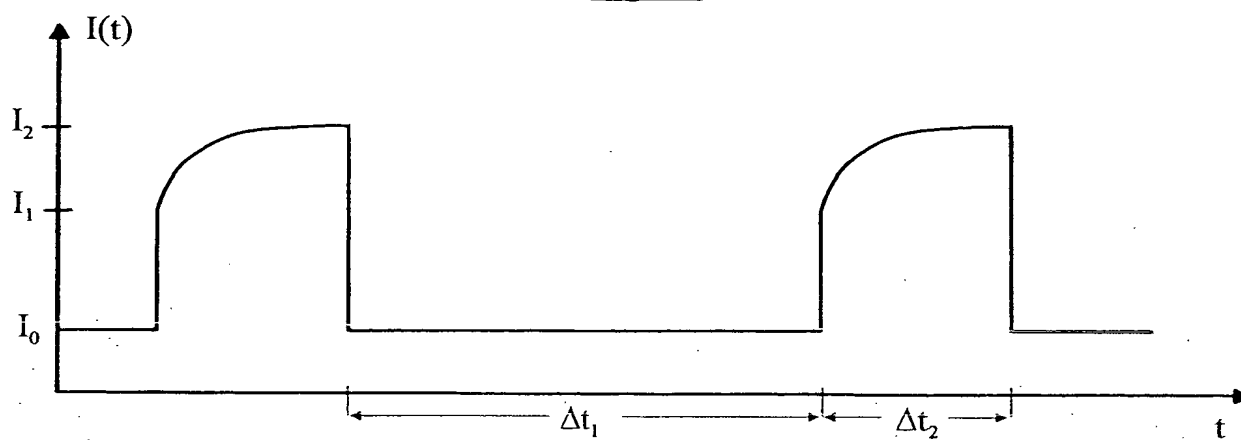


Fig. 3b

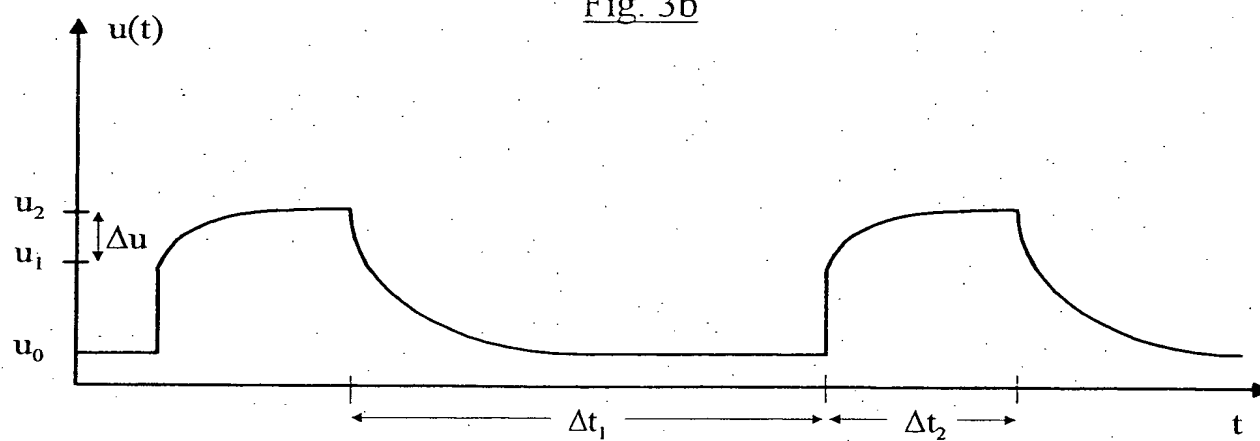


Fig. 3c

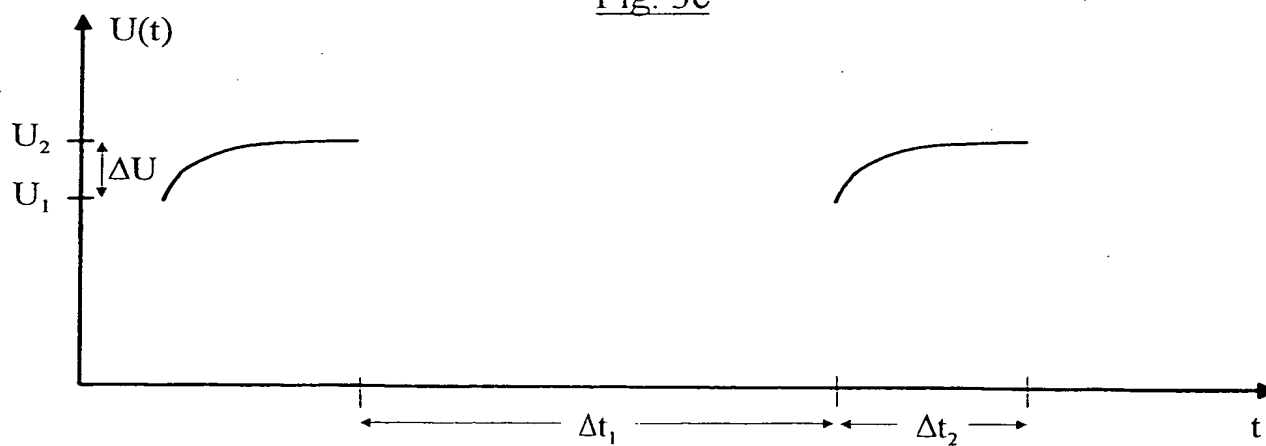
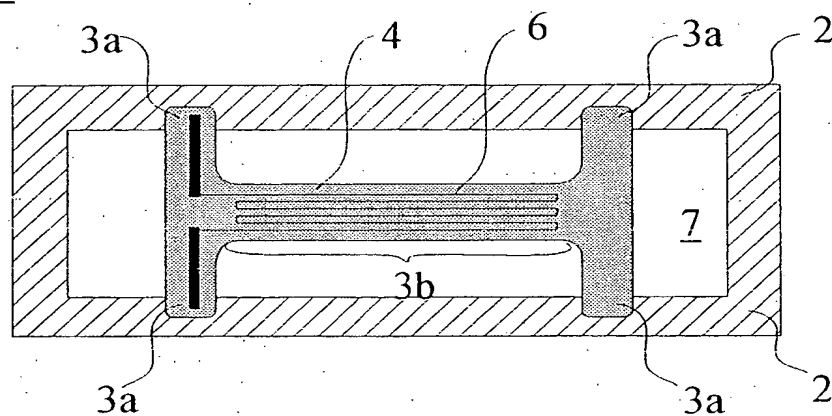


Fig. 4Fig. 5